



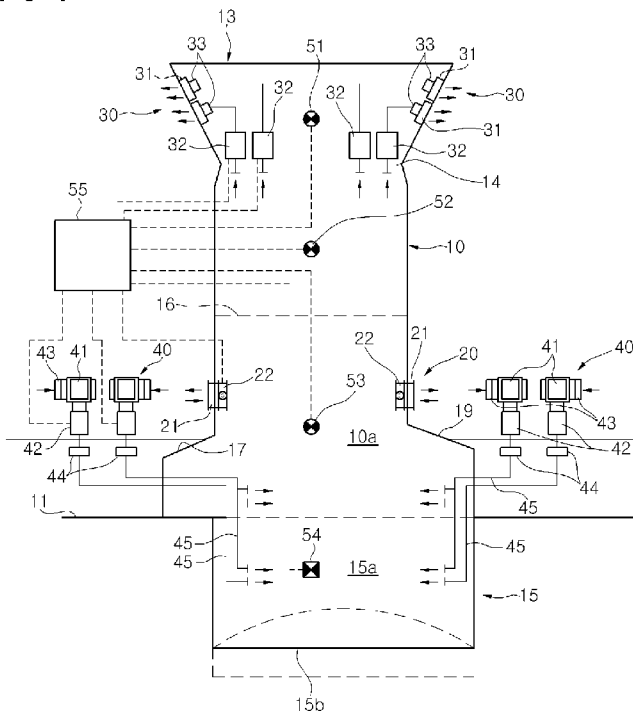
- (51) 국제특허분류:
B63J 2/02 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01)
B63B 35/44 (2006.01) F24F 11/02 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2011/004555
- (22) 국제출원일: 2011년 6월 22일 (22.06.2011)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2010-0115604 2010년 11월 19일 (19.11.2010) KR
- (71) 출원인 (US을(를) 제외한 모든 지정국에 대하여): **대우조선해양 주식회사 (DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD.)** [KR/KR]; 서울 중구 다동 85, 100-180 Seoul (KR).
- (72) 발명자; 겸
- (75) 발명자/출원인 (US에 한하여): **추금대 (CHOO, Keum Dae)** [KR/KR]; 경상남도 거제시 고현동 덕산 1 차아파트 106-704, 656-763 Gyeongsangnam-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 에이아이피 (AIP PATENT & LAW FIRM); 서울 강남구 역삼동 823-14 신원빌딩 8층, 135-933 Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[다음 쪽 계속]

(54) Title: TEMPERATURE AND PRESSURE MONITORING SYSTEM OF SEALED DERRICK STRUCTURE

(54) 발명의 명칭 : 밀폐형 데릭구조의 온도 및 압력 모니터링 시스템

[Fig. 1]



(57) Abstract: The present invention relates to a temperature and pressure monitoring system of a sealed derrick structure, wherein temperature and pressure of the sealed derrick structure are monitored to recognize whether the temperature and the pressure of the sealed derrick structure are abnormal, thereby making it possible to effectively respond to hazards. The invention, which is a temperature and pressure monitoring system of a sealed derrick structure that is communicated with a moon pool, comprises: one or more temperature sensors which are installed inside a sealed derrick, and monitor the inside temperature thereof; one or more pressure sensors which are installed inside said moon pool, and monitor inside pressure differences thereof; and one or more damping units which are installed on one side of said sealed derrick in order to overcome abnormal changes in the inside temperature of said sealed derrick and abnormal changes in the inside pressure of said moon pool, and induce or discharge the air to or from the inner side or the outer side of said sealed derrick, wherein as the abnormal inside temperature of said sealed derrick and the abnormal inside pressure of said moon pool are recognized by the monitoring functions of said temperature sensors and said pressure sensors, said damping units are selectively adjusted.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]

**공개:**

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

— 청구범위 보정서와 함께 (조약 제 19 조(1))

본 발명은 밀폐형 데릭구조의 온도 및 압력을 모니터링하여 밀폐형 데릭구조 내의 온도 및 압력의 이상여부를 인지함으로써 위험에 효과적으로 대처할 수 있는 밀폐형 데릭구조의 온도 및 압력 모니터링 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 문풀과 소통되는 밀폐형 데릭 구조의 온도 및 압력 모니터링시스템으로, 상기 밀폐형 데릭의 내부에 설치되어 그 내부 온도를 모니터링하는 하나 이상의 온도센서; 상기 문풀의 내부에 설치되어 그 내부의 압력차이를 모니터링하는 하나 이상의 압력센서; 및 상기 밀폐형 데릭의 내부 이상온도와 상기 문풀의 내부 이상압력 변화를 극복하기 위해 상기 밀폐형 데릭의 일 측면에 하나 이상 설치되어 상기 밀폐형 데릭의 내측 또는 외측으로 공기를 유입 또는 배출하는 댐핑 유닛을 포함하여, 상기 온도센서와 상기 압력센서의 모니터링에 의하여 상기 밀폐형 데릭의 내부 이상온도와 상기 문풀의 내부 이상압력을 인지함에 따라 선택적으로 상기 댐핑유닛이 조정되게 하는 것을 특징으로 한다.